PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of

Fujio AKAHANE, et al.

Appln. No.: 10/647,669

Confirmation No.: 2142

Filed: August 25, 2003

For: LIQUID EJECTION HEAD, AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENTS

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Submitted herewith are certified copies of the priority documents on which claims to priority was made under 35 U.S.C. § 119. The Examiner is respectfully requested to acknowledge receipt of said priority documents.

Respectfully submitted,

Registration No. 23,063

Docket No: Q77136

Group Art Unit: 2861

Examiner: Unknown

SUGHRUE MION, PLLC

Telephone: (202) 293-7060

Facsimile: (202) 293-7860

WASHINGTON OFFICE

23373

CUSTOMER NUMBER

Enclosures:

JAPAN 2002-243483

JAPAN 2002-290643

Date: February 17, 2004

Fujio AKAHANE, et al. Q77136 LIQUID EJECȚION HEAD.. Filing Date: February 17, 2004 Darryl Mexic 202-663-7909

日本国特許庁 1 of 2 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2002年 8月23日

出 願 番 号

特願2002-243483

Application Number: [ST. 10/C]:

[J P 2 0 0 2 - 2 4 3 4 8 3]

出 願 人

Applicant(s):

セイコーエプソン株式会社

2003年 9月 9日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





【書類名】

特許願

【整理番号】

J0092778

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

B41J 2/16

【発明者】

【住所又は居所】

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株

式会社内

【氏名】

赤羽 富士男

【発明者】

【住所又は居所】

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株

式会社内

【氏名】

高島 永光

【発明者】

【住所又は居所】

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株

式会社内

【氏名】

羽毛田 和重

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株

式会社内

【氏名】

上杉 良治

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株

式会社内

【氏名】

紅林 昭治

【特許出願人】

【識別番号】

000002369

【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社

【代理人】

【識別番号】 100095728

【弁理士】

【氏名又は名称】 上柳 雅誉

【連絡先】

 $0\ 2\ 6\ 6\ -\ 5\ 2\ -\ 3\ 1\ 3\ 9$

【選任した代理人】

【識別番号】 100107076

【弁理士】

【氏名又は名称】 藤綱 英吉

【選任した代理人】

【識別番号】 100107261

【弁理士】

【氏名又は名称】 須澤 修

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013044

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0109826

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 液体噴射ヘッドおよびその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 圧力発生室となる溝状窪部が隔壁部を介して上記溝状窪部の幅方向に列設されると共に、各溝状窪部の一端に板厚方向に貫通する連通口を形成した鍛造加工によるニッケル製の圧力発生室形成板と、上記連通口と対応する位置にノズル開口を穿設した金属製のノズルプレートと、溝状窪部の開口面を封止すると共に、溝状窪部の他端に対応する位置に液体供給口を穿設した金属製の封止板とを備え、圧力発生室形成板における溝状窪部側に封止板を、反対側にノズルプレートをそれぞれ接合してなる流路ユニットを備えた液体噴射ヘッドであって、上記ニッケルの結晶粒の粒径が上記隔壁部の厚さの30~60%とされていることを特徴とする液体噴射ヘッド。

【請求項 2 】 上記隔壁部の厚さは、 $20\sim50~\mu$ mである請求項 1 記載の液体噴射ヘッド。

【請求項3】 上記結晶粒の粒径は、8 μ m以上 2 5 μ m未満である請求項 1または2記載の液体噴射ヘッド。

【請求項4】 上記ニッケルは、ビッカース硬度がHv150以上Hv190未満である請求項 $1\sim3$ のいずれか一項に記載の液体噴射ヘッド。

【請求項5】 上記ニッケルは、伸びが5%超20%未満である請求項1~4のいずれか一項に記載の液体噴射ヘッド。

【請求項6】 上記圧力発生室形成板は、上記ニッケルの圧延材を鍛造加工することにより形成されている請求項1~5のいずれか一項に記載の液体噴射へッド。

【請求項7】 上記隔壁部の厚さTに対する隔壁部の高さHの比H/Tは、

1. $0 \sim 2$. 1である請求項 $1 \sim 6$ のいずれか一項に記載の液体噴射ヘッド。

【請求項8】 上記隔壁部の厚さTに対する上記溝状窪部の幅Wの比W/Tは、2.0~5.0である請求項1~6のいずれか一項に記載の液体噴射ヘッド

【請求項9】 上記隔壁部の厚さTに対する上記溝状窪部の深さDの比D/

Tは、 $2.0 \sim 4.5$ である請求項 $1 \sim 6$ のいずれか一項に記載の液体噴射へッド。

【請求項10】 上記溝状窪部の底面は溝状窪部の長手方向に延びるV字状の形状とされ、このV字部分の内角は45~110度である請求項1~9のいずれか一項に記載の液体噴射ヘッド。

【請求項11】 上記溝状窪部のピッチ寸法は、0.3 mm以下である請求項1~10のいずれか一項に記載の液体噴射ヘッド。

【請求項12】 圧力発生室となる溝状窪部が隔壁部を介して上記溝状窪部の幅方向に列設されると共に、各溝状窪部の一端に板厚方向に貫通する連通口を形成した鍛造加工によるニッケル製の圧力発生室形成板と、上記連通口と対応する位置にノズル開口を穿設した金属製のノズルプレートと、溝状窪部の開口面を封止すると共に、溝状窪部の他端に対応する位置に液体供給口を穿設した金属製の封止板とを備え、圧力発生室形成板における溝状窪部側に封止板を、反対側にノズルプレートをそれぞれ接合してなる流路ユニットを備えた液体噴射ヘッドの製造方法であって、請求項1~11のいずれか一項に記載の寸法、形状を備えた溝状窪部を圧力発生室形成板に鍛造加工により成形することを特徴とする液体噴射ヘッドの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、圧力発生室形成板に鍛造加工が施される液体噴射ヘッドおよびその製造方法に関するものである。

[00002]

【従来の技術】

鍛造加工は種々な製品分野で活用されているが、例えば、液体噴射ヘッドの圧力発生室を金属素材に鍛造で成形することが考えられる。上記液体噴射ヘッドは、加圧された液体をノズル開口から液滴として吐出させるものであり、種々な液体を対象にしたものが知られている。そのなかでも代表的なものとして、インクジェット式記録ヘッドをあげることができる。そこで、従来の技術を上記インク

3/

ジェット式記録ヘッドを例にとって説明する。

[0003]

インクジェット式記録へッド(以下、記録ヘッドと称する。)は、共通インク室から圧力発生室を経てノズル開口に至る一連の流路を、ノズル開口に対応させて複数備えている。そして、小型化の要請から各圧力発生室は、記録密度に対応した細かいピッチで形成する必要がある。このため、隣り合う圧力発生室同士を区画する隔壁部の肉厚は極めて薄くなっている。また、圧力発生室と共通インク室とを連通するインク供給口は、圧力発生室内のインク圧力をインク滴の吐出に効率よく使用するため、その流路幅が圧力発生室よりもさらに絞られている。このような微細形状の圧力発生室及びインク供給口を寸法精度良く作製する観点から、従来の記録ヘッドでは、シリコン基板が好適に用いられている。すなわち、シリコンの異方性エッチングにより結晶面を露出させ、この結晶面で圧力発生室やインク供給口を区画形成している。

[0004]

また、ノズル開口が形成されるノズルプレートは、加工性等の要請から金属板により作製されている。そして、圧力発生室の容積を変化させるためのダイヤフラム部は、弾性板に形成されている。この弾性板は、金属製の支持板上に樹脂フィルムを貼り合わせた二重構造であり、圧力発生室に対応する部分の支持板を除去することで作製されている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

上記圧力発生室をシリコン基板に成形した場合、シリコンと金属との線膨張率の差が大きいため、シリコン基板、ノズルプレート及び弾性板の各部材を貼り合わせるにあたり、比較的低温の下で長時間をかけて接着する必要があった。このため、生産性の向上が図り難く、製造コストが嵩む一因となっていた。このため、塑性加工によって圧力発生室を金属製基板に形成する試みがなされているが、圧力発生室が極めて微細であること、及び、インク供給口の流路幅を圧力発生室よりも狭くする必要があること等から高精度の加工が困難であり、ヘッドの組立精度の向上も図り難いという問題点があった。

'[00'06]

このような事情の中にあって、圧力発生室を金属の鍛造加工により成形するときには、金属鍛造加工における特有の問題が解決されなければならない。それは、圧力発生室形成板において圧力発生室となる溝状窪部は、隔壁部を介して上記溝状窪部の幅方向に鍛造加工によって列設され、このような構造は非常に微細なものとして所定どおりの寸法精度や形状精度で形成されなければならないことである。そのためには、圧力発生室形成板を形成する金属材料の材料的特質のなかから上記溝状窪部にとって最良の特性値を見極めて、よりすぐれた精密鍛造を行う必要がある。圧力発生室の成形精度が不十分であると、圧力発生室形成板を流路ユニットとして組立てたときの組立て精度等が低下し、極端な場合にはインク滴の吐出特性に支障を来す恐れがある。

[0007]

本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、高精度の圧力発生室 形成板を鍛造で成形するに当たり、圧力発生室形成板を形成する金属材料の材料 的特質のなかから上記溝状窪部にとって最良の特性値を見極めて、よりすぐれた 精密鍛造を行うことをその主たる目的としている。

[8000]

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するため、本発明の液体噴射ヘッドは、圧力発生室となる溝状 窪部が隔壁部を介して上記溝状窪部の幅方向に列設されると共に、各溝状窪部の 一端に板厚方向に貫通する連通口を形成した鍛造加工によるニッケル製の圧力発 生室形成板と、上記連通口と対応する位置にノズル開口を穿設した金属製のノズ ルプレートと、溝状窪部の開口面を封止すると共に、溝状窪部の他端に対応する 位置に液体供給口を穿設した金属製の封止板とを備え、圧力発生室形成板におけ る溝状窪部側に封止板を、反対側にノズルプレートをそれぞれ接合してなる流路 ユニットを備えた液体噴射ヘッドであって、上記ニッケルの結晶粒の粒径が上記 隔壁部の厚さの30~60%とされていることを要旨とする。

(0009)

すなわち、上記ニッケルの結晶粒の粒径が上記隔壁部の壁の厚さの30~60

%とされているのである。

 \bigcirc

[0010]

上記のような隔壁部は、雄型(鍛造加工パンチ)のきわめて微細な幅の空隙部内に、素材であるニッケルが塑性流動をすることによって成形されるのであるが、このときの塑性流動が良好におこなわれるかどうかは、ニッケルの結晶粒の粒径を空隙部の間隔すなわち隔壁部の壁の厚さとの相対関係で最良の粒径寸法として選定しなければならない。

$\{0\ 0\ 1\ 1\}$

上記のようにニッケルの結晶粒の粒径が、壁の厚さの30~60%とされていることにより、結晶粒の粒径が上記空隙部の幅を下回っているとともに、粒径は壁の厚さに対して過小でもなく過大でもない領域におかれているので、微細な空隙部内への結晶粒の流動が円滑になされ、良好な溝状窪部の成形が行える。

[0012]

さらに、壁の厚さ方向で見た結晶粒の配列個数は多くて2個強,少なくて2個未満となり結晶粒の個数が異常に多くなるものではないので、上記空隙部内への塑性流動が円滑になされる。もし、結晶粒の上記配列個数が多い側の上記個数を上回る場合には、壁の厚さに対する結晶粒の増加により、結晶粒界が隔壁部において増量することになるので、塑性変形性(転位の運動)が低下し、空隙部内への塑性流動性が低下して微細な隔壁部の塑性加工に支障を来すことになり、所定形状,所定寸法の溝状窪部がえにくくなる。

[0013]

逆に、もし、結晶粒の上記配列個数が少ない側の上記個数を下回る場合には、 塑性流動は良好に果たされるが、結晶粒の大きさが隔壁部にとっては過大になり 、それにともなうニッケル材の強度低下のため、かえって微細な隔壁部を高精度 に加工することが困難となる。

[0014]

本発明によれば、結晶粒の配列個数に換算すると上記のような範囲の値になるので、上記のように良好な塑性流動がえられて、所定の形状精度、寸法精度の溝 状窪部が成形できるのである。また、結晶粒の粒径に注目した上記の数値(隔壁



部の壁の厚さの30~60%)により、塑性流動が円滑になされるので、溝状窪 部を成形する鍛造加工パンチの割れや素材の焼き付き等が防止されて、耐久性が 大幅に向上するうえ、微細形状部の成形性を良好なものとしているのである。

$\{0015\}$

本発明の液体噴射ヘッドにおいて、上記隔壁部の厚さが、 $20\sim50~\mu$ mである場合には、隔壁部の壁の厚さを溝状窪部の列設数をできるだけ多くするために要求される $20\sim50~\mu$ mに対し、上記の結晶粒の粒径適合により、きわめて良好な隔壁部の塑性流動が実現して、微小な $20\sim50~\mu$ mなる隔壁部の厚さとすることができて、多数の溝状窪部自体を高精度のもとに列設することができる。

[0016]

本発明の液体噴射ヘッドにおいて、上記結晶粒の粒径が、 8μ m以上 25μ m 未満である場合には、結晶粒がこのような範囲の粒径とされていることにより、上述のように円滑に雄型の空隙部内に塑性流動がなされ、精度の高い十分な高さの隔壁部が構成できる。また、上記のように結晶粒界が過剰な量になるのを意図的に制限して、微細形状部の成形性を良好なものとしているのである。

$\{0017\}$

本発明の液体噴射ヘッドにおいて、上記ニッケルは、ビッカース硬度がHv150以上Hv190未満である場合には、ニッケル自体の硬度が塑性流動に適した柔かな範囲の値とされているので、上記の結晶粒の粒径設定による塑性流動性の向上と相俟って、微細な溝状窪部の成形が確実に行える。また、鍛造加工にとっては柔かな領域の硬度であるから、鍛造加工パンチの耐久性向上や加工精度の確保にとって有利である。

[0018]

本発明の液体噴射ヘッドにおいて、上記ニッケルは、伸びが5%超20%未満である場合には、溝状窪部の鍛造加工に必要な素材の伸びが十分に確保されているので、塑性流動は十分になされる。また、鍛造加工時に生じる素材の伸びは、上記伸びの範囲に対してわずかな量であるから、成形各部における弾性復元力を可及的に少なくすることができる。このため、残留応力の少量化にとって有効であり、鍛造加工後の弾性復元による変形を実害のない範囲におさめることができ

、溝状窪部の成形精度の向上や圧力発生室形成板の湾曲変形の防止に有効である。 。

[0019]

本発明の液体噴射ヘッドにおいて、上記圧力発生室形成板が、上記ニッケルの 圧延材を鍛造加工することにより形成されている場合には、圧延による素材板の 厚さが高精度のもとで管理される。そして、このようにして品質管理の行われた ニッケル圧延材を鍛造加工の素材板にするので、上記の各数値内における良好な 鍛造加工が実現し、高精度の溝状窪部や隔壁部が成形できるのである。さらに、 圧延工程で形成されたニッケルの組織状態に応じて、溝状窪部の長手方向の向き 等を選定することにより、より円滑な塑性流動がえられる。

[0020]

本発明の液体噴射ヘッドにおいて、上記隔壁部の厚さTに対する隔壁部の高さHの比H/Tが、1. 0 \sim 2 . 1 である場合には、隔壁部の剛性が低下しない程度の隔壁部の高さの比が確保できるので、列設された溝状窪部の剛性を適正に確保することができる。

$[0\ 0\ 2\ 1]$

本発明の液体噴射ヘッドにおいて、上記隔壁部の厚さTに対する上記溝状窪部の幅Wの比W/Tが、2.0~5.0である場合には、必要最小限の隔壁部の壁の厚さに対して十分な幅の溝状窪部が形成できるので、溝状窪部の容積を所定どおりに確保するとともに、溝状窪部を最も緻密な状態で列設し、単位長さ当たりの溝状窪部の列設数をできるだけ多くすることが可能となる。

[0022]

本発明の液体噴射ヘッドにおいて、上記隔壁部の厚さTに対する上記溝状窪部の深さDの比D/Tが、2.0~4.5である場合には、必要最小限の隔壁部の壁の厚さに対して十分な深さの溝状窪部が形成できるので、溝状窪部の容積を所定どおりに確保するとともに、隔壁部に十分な剛性を持たせることができる。

[0023]

本発明の液体噴射ヘッドにおいて、上記溝状窪部の底面は溝状窪部の長手方向 に延びるV字状の形状とされ、このV字部分の内角が45~110度である場合

8/



には、上記底面の部分において溝状窪部の容積を十分に拡大することができる。 このように深さの方向で容積拡大ができることにより、溝状窪部の幅を小さくす ることができ、できるだけ多くの溝状窪部を列設することができる。

[0024]

本発明の液体噴射ヘッドにおいて、上記溝状窪部のピッチ寸法が、0.3 mm 以下である場合には、精密な微細部品であるインクジェット式記録ヘッドの圧力 発生室を加工するようなときに、上記のような数値設定(例えば、結晶粒の粒径 が壁の厚さの40~60%等)により、溝状窪部のピッチ寸法が0.3 mm以下 のようなきわめて微細な溝状窪部の成形が可能となる。

[0025]

上記目的を達成するため、本発明の液体噴射ヘッドの製造方法は、圧力発生室となる溝状窪部が隔壁部を介して上記溝状窪部の幅方向に列設されると共に、各溝状窪部の一端に板厚方向に貫通する連通口を形成した鍛造加工によるニッケル製の圧力発生室形成板と、上記連通口と対応する位置にノズル開口を穿設した金属製のノズルプレートと、溝状窪部の開口面を封止すると共に、溝状窪部の他端に対応する位置に液体供給口を穿設した金属製の封止板とを備え、圧力発生室形成板における溝状窪部側に封止板を、反対側にノズルプレートをそれぞれ接合してなる流路ユニットを備えた液体噴射ヘッドの製造方法であって、請求項1~11のいずれか一項に記載の寸法、形状を備えた溝状窪部を圧力発生室形成板に鍛造加工により成形することを要旨とする。

[0026]

すなわち、請求項1~11のいずれか一項に記載の寸法,形状を備えた溝状窪部を圧力発生室形成板に鍛造加工により成形するものである。

[0027]

したがって、上記のような数値設定、例えば、結晶粒の粒径が壁の厚さの30~60%,ニッケルのビッカース硬度がHv150以上Hv190未満,ニッケルの伸びが5%超20%未満等の条件下で圧力発生室形成板に鍛造加工を行うことにより、より円滑な塑性流動がえられて、形状精度,寸法精度の高い圧力発生室形成板が形成され、引いては良好な液体噴射特性を備えた液体噴射へッドが製

造できる。また、上述のような数値設定により、鍛造加工パンチの負担が少なく てその耐久性が著しく長期化される。

[0028]

 \odot

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明するが、まず最初に本発明が 適用される液体噴射ヘッドの構成について説明する。

[0029]

本発明が適用される液体噴射ヘッドは、インクジェット式記録装置の記録ヘッドとして実施するのが適しているので、図示の実施の形態においては液体噴射ヘッドの代表的な事例として、上記記録ヘッドを示している。

[0030]

図1及び図2に示すように、記録ヘッド1は、ケース2と、このケース2内に 収納される振動子ユニット3と、ケース2の先端面に接合される流路ユニット4 と、先端面とは反対側のケース2の取付面上に配置される接続基板5と、ケース 2の取付面側に取り付けられる供給針ユニット6等から概略構成されている。

[0031]

上記の振動子ユニット3は、図3に示すように、圧電振動子群7と、この圧電振動子群7が接合される固定板8と、圧電振動子群7に駆動信号を供給するためのフレキシブルケーブル9とから概略構成される。

[0032]

圧電振動子群 7 は、列状に形成された複数の圧電振動子 10 …を備える。各圧電振動子 10 …は、圧力発生素子の一種であり、電気機械変換素子の一種でもある。これらの各圧電振動子 10 …は、列の両端に位置する一対のダミー振動子 10 a , 10 a と、これらのダミー振動子 10 a , 10 a の間に配置された複数の駆動振動子 10 b … とから構成されている。そして、各駆動振動子 10 b … は、例えば、10 2 10 2 10 3 10 3 10 3 10 3 10 5 10 5 10 6 10 7 10 7 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 9

(0033)

各圧電振動子10…は、固定端部を固定板8上に接合することにより、自由端部を固定板8の先端面よりも外側に突出させている。すなわち、各圧電振動子10…は、いわゆる片持ち梁の状態で固定板8上に支持されている。そして、各圧電振動子10…の自由端部は、圧電体と内部電極とを交互に積層して構成されており、対向する電極間に電位差を与えることで素子長手方向に伸縮する。

[0034]

フレキシブルケーブル9は、固定板8とは反対側となる固定端部の側面で圧電振動子10と電気的に接続されている。そして、このフレキシブルケーブル9の表面には、圧電振動子10の駆動等を制御するための制御用IC11が実装されている。また、各圧電振動子10…を支持する固定板8は、圧電振動子10からの反力を受け止め得る剛性を備えた板状部材であり、ステンレス板等の金属板が好適に用いられる。

[0035]

上記のケース 2 は、例えば、エポキシ系樹脂等の熱硬化性樹脂で成型されたブロック状部材である。ここで、ケース 2 を熱硬化性樹脂で成型しているのは、この熱硬化性樹脂は、一般的な樹脂よりも高い機械的強度を有しており、線膨張係数が一般的な樹脂よりも小さく、周囲の温度変化による変形が小さいからである。そして、このケース 2 の内部には、振動子ユニット 3 を収納可能な収納空部 1 2 と、インクの流路の一部を構成するインク供給路 1 3 とが形成されている。また、ケース 2 の先端面には、共通インク室(リザーバ) 1 4 となる先端凹部 1 5 が形成されている。

[0036]

収納空部12は、振動子ユニット3を収納可能な大きさの空部である。この収納空部12の先端側部分はケース内壁が側方に向けて部分的に突出しており、この突出部分の上面が固定板当接面として機能する。そして、振動子ユニット3は、各圧電振動子10の先端が開口から臨む状態で収納空部12内に収納される。この収納状態において、固定板8の先端面は固定板当接面に当接した状態で接着されている。

[0037]

先端凹部15は、ケース2の先端面を部分的に窪ませることにより作製されている。本実施形態の先端凹部15は、収納空部12よりも左右外側に形成された略台形状の凹部であり、収納空部12側に台形の下底が位置するように形成されている。

[0038]

インク供給路13は、ケース2の高さ方向を貫通するように形成され、先端が 先端凹部15に連通している。また、インク供給路13における取付面側の端部 は、取付面から突設した接続口16内に形成されている。

[0039]

上記の接続基板5は、記録ヘッド1に供給する各種信号用の電気配線が形成されると共に、信号ケーブルを接続可能なコネクタ17が取り付けられた配線基板である。そして、この接続基板5は、ケース2における取付面上に配置され、フレキシブルケーブル9の電気配線が半田付け等によって接続される。また、コネクタ17には、制御装置(図示せず)からの信号ケーブルの先端が挿入される。

[0040]

上記の供給針ユニット6は、インクカートリッジ(図示せず)が接続される部分であり、針ホルダ18と、インク供給針19と、フィルタ20とから概略構成される。

[0041]

インク供給針19は、インクカートリッジ内に挿入される部分であり、インクカートリッジ内に貯留されたインクを導入する。このインク供給針19の先端部は円錐状に尖っており、インクカートリッジ内に挿入し易くなっている。また、この先端部には、インク供給針19の内外を連通するインク導入孔が複数穿設されている。そして、本実施形態の記録ヘッド1は2種類のインクを吐出可能であるため、このインク供給針19を2本備えている。

[0042]

針ホルダ18は、インク供給針19を取り付けるための部材であり、その表面にはインク供給針19の根本部分を止着するための台座21を2本分横並びに形

成している。この台座21は、インク供給針19の底面形状に合わせた円形状に作製されている。また、台座底面の略中心には、針ホルダ18の板厚方向を貫通するインク排出口22を形成している。また、この針ホルダ18には、フランジ部を側方に延出している。

[0043]

フィルタ20は、埃や成型時のバリ等のインク内の異物の通過を阻止する部材であり、例えば、目の細かな金属網によって構成される。このフィルタ20は、 台座21内に形成されたフィルタ保持溝に接着されている。

[0044]

そして、この供給針ユニット6は、図2に示すように、ケース2の取付面上に 配設される。この配設状態において、供給針ユニット6のインク排出口22とケ ース2の接続口16とは、パッキン23を介して液密状態で連通する。

[0045]

次に、上記の流路ユニット4について説明する。この流路ユニット4は、圧力発生室形成板30の一方の面にノズルプレート31を、圧力発生室形成板30の他方の面に弾性板32を接合した構成である。

[0046]

圧力発生室形成板30は、図4に示すように、溝状窪部33と、連通口34と、逃げ凹部35とを形成した金属製の板状部材である。本実施形態では、この圧力発生室形成板30を、厚さ0.35mmのニッケル製の基板を加工することで作製している。

$\{0047\}$

ここで、基板としてニッケルを選定した理由について説明する。第1の理由は、このニッケルの線膨張係数が、ノズルプレート31や弾性板32の主要部を構成する金属(本実施形態では後述するようにステンレス)の線膨張係数と略等しいからである。すなわち、流路ユニット4を構成する圧力発生室形成板30、弾性板32及びノズルプレート31の線膨張係数が揃うと、これらの各部材を加熱接着した際において、各部材は均等に膨張する。このため、膨張率の相違に起因する反り等の機械的ストレスが発生し難い。その結果、接着温度を高温に設定し

ても各部材を支障なく接着することができる。また、記録ヘッド1の作動時に圧電振動子10が発熱し、この熱によって流路ユニット4が加熱されたとしても、流路ユニット4を構成する各部材30,31,32が均等に膨張する。このため、記録ヘッド1の作動に伴う加熱と作動停止に伴う冷却とが繰り返し行われても、流路ユニット4を構成する各部材30,31,32に剥離等の不具合は生じ難い。

[0048]

第2の理由は、防錆性に優れているからである。すなわち、この種の記録へッド1では水性インクが好適に用いられているので、長期間に亘って水が接触しても錆び等の変質が生じないことが肝要である。その点、ニッケルは、ステンレスと同様に防錆性に優れており、錆び等の変質が生じ難い。

[0049]

第3の理由は、展性に富んでいるからである。すなわち、圧力発生室形成板30を作製するにあたり、本実施形態では後述するように塑性加工(例えば、鍛造加工)で行っている。そして、圧力発生室形成板30に形成される溝状窪部33や連通口34は、極めて微細な形状であり、且つ、高い寸法精度が要求される。そして、基板にニッケルを用いると、展性に富んでいることから塑性加工であっても溝状窪部33や連通口34を高い寸法精度で形成することができる。

[0050]

なお、圧力発生室形成板30に関し、上記した各要件、すなわち、線膨張係数の要件、防錆性の要件、及び、展性の要件を満たすならば、ニッケル以外の金属で構成してもよい。

[0051]

溝状窪部33は、圧力発生室29となる溝状の窪部であり、図5に拡大して示すように、直線状の溝によって構成されている。本実施形態では、幅約0.1mm, 長さ約1.5mm, 深さ約0.1mmの溝を溝幅方向に180個列設している。この溝状窪部33の底面は、深さ方向(すなわち、奥側)に進むに連れて縮幅されてV字状に窪んでいる。底面をV字状に窪ませたのは、隣り合う圧力発生室29,29同士を区画する隔壁部28の剛性を高めるためである。すなわち、



底面をV字状に窪ませることにより、隔壁部28の根本部分(底面側の部分)の 肉厚が厚くなって隔壁部28の剛性が高まる。そして、隔壁部28の剛性が高く なると、隣の圧力発生室29からの圧力変動の影響を受け難くなる。すなわち、 隣の圧力発生室29からのインク圧力の変動が伝わり難くなる。また、底面をV 字状に窪ませることにより、溝状窪部33を塑性加工によって寸法精度よく形成 することもできる(後述する)。そして、このV字の角度は、加工条件によって 規定されるが、例えば90度前後である。さらに、隔壁部28における先端部分 の肉厚が極く薄いことから、各圧力発生室29…を密に形成しても必要な容積を 確保することができる。

[0052]

また、本実施形態における溝状窪部33に関し、その長手方向両端部は、奥側に進むにつれて内側に下り傾斜している。すなわち、溝状窪部33の長手方向両端部は、面取形状に形成されている。このように構成したのも、溝状窪部33を塑性加工によって寸法精度よく形成するためである。

[0053]

さらに、両端部の溝状窪部33,33に隣接させてこの溝状窪部33よりも幅 広なダミー窪部36を1つずつ形成している。このダミー窪部36は、インク滴 の吐出に関与しないダミー圧力発生室となる溝状の窪部である。本実施形態のダ ミー窪部36は、幅約0.2mm,長さ約1.5mm,深さ約0.1mmの溝に よって構成されている。そして、このダミー窪部36の底面は、W字状に窪んで いる。これも、隔壁部28の剛性を高めるため、及び、ダミー窪部36を塑性加 工によって寸法精度よく形成するためである。

[0054]

そして、各溝状窪部33…及び一対のダミー窪部36,36によって窪部列が 構成される。本実施形態では、この窪部列を横並びに2列形成している。

(0055)

連通口34は、溝状窪部33の一端から板厚方向を貫通する貫通孔として形成している。この連通口34は、溝状窪部33毎に形成されており、1つの窪部列に180個形成されている。本実施形態の連通口34は、開口形状が矩形状であ

り、圧力発生室形成板30における溝状窪部33側から板厚方向の途中まで形成 した第1連通口37と、溝状窪部33とは反対側の表面から板厚方向の途中まで 形成した第2連通口38とから構成されている。

[0056]

そして、第1連通口37と第2連通口38とは断面積が異なっており、第2連通口38の内寸法が第1連通口37の内寸法よりも僅かに小さく設定されている。これは、連通口34をプレス加工によって作製していることに起因する。すなわち、この圧力発生室形成板30は、厚さ0.35mmのニッケル板を加工することで作製しているため、連通口34の長さは、溝状窪部33の深さを差し引いても0.25mm以上となる。そして、連通口34の幅は、溝状窪部33の溝幅よりも狭くする必要があるので、0.1mm未満に設定される。このため、連通口34を1回の加工で打ち抜こうとすると、アスペクト比の関係で雄型(ポンチ)が座屈するなどしてしまう。そこで、本実施形態では、加工を2回に分け、1回目の加工では第1連通口37を板厚方向の途中まで形成し、2回目の加工で第2連通口38を形成している。なお、この連通口34の加工手順については、後で説明する。

[0057]

また、ダミー窪部36にはダミー連通口39が形成されている。このダミー連通口39は、上記の連通口34と同様に、第1ダミー連通口40と第2ダミー連通口41とから構成されており、第2ダミー連通口41の内寸法が第1ダミー連通口40の内寸法よりも小さく設定されている。

[0058]

なお、本実施形態では、上記の連通口34及びダミー連通口39に関し、開口 形状が矩形状の貫通孔によって構成されたものを例示したが、この形状に限定さ れるものではない。例えば、円形に開口した貫通孔によって構成してもよい。

[0059]

逃げ凹部35は、共通インク室14におけるコンプライアンス部の作動用空間を形成する。本実施形態では、ケース2の先端凹部15と略同じ形状であって、深さが溝状窪部33と等しい台形状の凹部によって構成している。

100601

次に、上記の弾性板32について説明する。この弾性板32は、封止板の一種であり、例えば、支持板42上に弾性体膜43を積層した二重構造の複合材(本発明の金属材の一種)によって作製される。本実施形態では、支持板42としてステンレス板を用い、弾性体膜43としてPPS(ポリフェニレンサルファイド)を用いている。

[0061]

図6に示すように、弾性板32には、ダイヤフラム部44と、インク供給口45と、コンプライアンス部46とを形成している。

[0062]

ダイヤフラム部44は、圧力発生室29の一部を区画する部分である。すなわち、ダイヤフラム部44は溝状窪部33の開口面を封止し、この溝状窪部33と共に圧力発生室29を区画形成する。このダイヤフラム部44は、図7(a)に示すように、溝状窪部33に対応した細長い形状であり、溝状窪部33を封止する封止領域に対し、各溝状窪部33…毎に形成されている。具体的には、ダイヤフラム部44の幅は溝状窪部33の溝幅と略等しく設定され、ダイヤフラム部44の長さは溝状窪部33の長さよりも多少短く設定されている。長さに関し、本実施形態では、溝状窪部33の長さの約2/3に設定されている。そして、形成位置に関し、図2に示すように、ダイヤフラム部44の一端を、溝状窪部33の一端(連通口34側の端部)に揃えている。

[0063]

このダイヤフラム部44は、図7(b)に示すように、溝状窪部33に対応する部分の支持板42をエッチング等によって環状に除去して弾性体膜43のみとすることで作製され、この環内には島部47を形成している。この島部47は、圧電振動子10の先端面が接合される部分である。

[0064]

インク供給口45は、圧力発生室29と共通インク室14とを連通するための 孔であり、弾性板32の板厚方向を貫通している。このインク供給口45も、ダイヤフラム部44と同様に、溝状窪部33に対応する位置に各溝状窪部33…毎 に形成されている。このインク供給口45は、図2に示すように、連通口34とは反対側の溝状窪部33の他端に対応する位置に穿設されている。また、このインク供給口45の直径は、溝状窪部33の溝幅よりも十分に小さく設定されている。本実施形態では、23ミクロンの微細な貫通孔によって構成している。

[0065]

 \bigcirc

このようにインク供給口45を微細な貫通孔にした理由は、圧力発生室29と 共通インク室14との間に流路抵抗を付与するためである。すなわち、この記録 ヘッド1では、圧力発生室29内のインクに付与した圧力変動を利用してインク 滴を吐出させている。このため、インク滴を効率よく吐出させるためには、圧力 発生室29内のインク圧力をできるだけ共通インク室14側に逃がさないように することが肝要である。この観点から本実施形態では、インク供給口45を微細 な貫通孔によって構成している。

[0066]

そして、本実施形態のように、インク供給口45を貫通孔によって構成すると、加工が容易であり、高い寸法精度が得られるという利点がある。すなわち、このインク供給口45は貫通孔であるため、レーザー加工による作製が可能である。従って、微細な直径であっても高い寸法精度で作製でき、作業も容易である。

[0067]

コンプライアンス部46は、共通インク室14の一部を区画する部分である。 すなわち、コンプライアンス部46と先端凹部15とで共通インク室14を区画 形成する。このコンプライアンス部46は、先端凹部15の開口形状と略同じ台 形状であり、支持板42の部分をエッチング等によって除去し、弾性体膜43だ けにすることで作製される。

[0068]

なお、弾性板32を構成する支持板42及び弾性体膜43は、この例に限定されるものではない。例えば、弾性体膜43としてポリイミドを用いてもよい。また、この弾性板32を、ダイヤフラム部44になる厚肉部及び該厚肉部周辺の薄肉部と、コンプライアンス部46になる薄肉部とを設けた金属板で構成してもよい。



400691

次に、上記のノズルプレート31について説明する。ノズルプレート31は、 ノズル開口48を列設した金属製の板状部材である。本実施形態ではステンレス 板を用い、ドット形成密度に対応したピッチで複数のノズル開口48…を開設し ている。本実施形態では、合計180個のノズル開口48…を列設してノズル列 を構成し、このノズル列を2列横並びに形成している。そして、このノズルプレ ート31を圧力発生室形成板30の他方の表面、すなわち、弾性板32とは反対 側の表面に接合すると、対応する連通口34に各ノズル開口48…が臨む。

[0070]

そして、上記の弾性板32を、圧力発生室形成板30の一方の表面、すなわち、溝状窪部33の形成面に接合すると、ダイヤフラム部44が溝状窪部33の開口面を封止して圧力発生室29が区画形成される。同様に、ダミー窪部36の開口面も封止されてダミー圧力発生室が区画形成される。また、上記のノズルプレート31を圧力発生室形成板30の他方の表面に接合するとノズル開口48が対応する連通口34に臨む。この状態で島部47に接合した圧電振動子10を伸縮すると、島部周辺の弾性体膜43が変形し、島部47が溝状窪部33側に押されたり、溝状窪部33側から離隔する方向に引かれたりする。この弾性体膜43の変形により、圧力発生室29が膨張したり収縮したりして圧力発生室29内のインクに圧力変動が付与される。

[0071]

さらに、弾性板32(すなわち、流路ユニット4)をケース2に接合すると、コンプライアンス部46が先端凹部15を封止する。このコンプライアンス部46は、共通インク室14に貯留されたインクの圧力変動を吸収する。すなわち、貯留されたインクの圧力に応じて弾性体膜43が膨張したり収縮したりして変形する。そして、上記の逃げ凹部35は、弾性体膜43の膨張時において、弾性体膜43が膨らむための空間を形成する。

[0072]

上記構成の記録ヘッド1は、インク供給針19から共通インク室14までの共通インク流路と、共通インク室14から圧力発生室29を通って各ノズル開口4



8…に至る個別インク流路とを有する。そして、インクカートリッジに貯留されたインクは、インク供給針19から導入されて共通インク流路を通って共通インク室14に貯留される。この共通インク室14に貯留されたインクは、個別インク流路を通じてノズル開口48から吐出される。

[0073]

例えば、圧電振動子10を収縮させると、ダイヤフラム部44が振動子ユニット3側に引っ張られて圧力発生室29が膨張する。この膨張により圧力発生室29内が負圧化されるので、共通インク室14内のインクがインク供給口45を通って各圧力発生室29に流入する。その後、圧電振動子10を伸張させると、ダイヤフラム部44が圧力発生室形成板30側に押されて圧力発生室29が収縮する。この収縮により、圧力発生室29内のインク圧力が上昇し、対応するノズル開口48からインク滴が吐出される。

[0074]

そして、この記録ヘッド1では、圧力発生室29(溝状窪部33)の底面がV字状に窪んでいる。このため、隣り合う圧力発生室29,29同士を区画する隔壁部28は、その根本部分の肉厚が先端部分の肉厚よりも厚く形成される。これにより、隔壁部28の剛性を従来よりも高めることができる。従って、インク滴の吐出時において、圧力発生室29内にインク圧力の変動が生じたとしても、その圧力変動を隣の圧力発生室29に伝わり難くすることができる。その結果、所謂隣接クロストークを防止でき、インク滴の吐出を安定化できる。

[0075]

また、本実施形態では、共通インク室14と圧力発生室29とを連通するインク供給口45を、弾性板32の板厚方向を貫通する微細孔によって構成したので、レーザー加工等によって高い寸法精度が容易に得られる。これにより、各圧力発生室29…へのインクの流入特性(流入速度や流入量等)を高いレベルで揃えることができる。さらに、レーザー光線によって加工を行った場合には、加工も容易である。

[0076]

また、本実施形態では、列端部の圧力発生室29,29に隣接させてインク滴



の吐出に関与しないダミー圧力発生室(すなわち、ダミー窪部36と弾性板32とによって区画される空部)を設けたので、これらの両端の圧力発生室29,29に関し、片側には隣りの圧力発生室29が形成され、反対側にはダミー圧力発生室が形成されることになる。これにより、列端部の圧力発生室29,29に関し、その圧力発生室29を区画する隔壁の剛性を、列途中の他の圧力発生室29…における隔壁の剛性に揃えることができる。その結果、一列全ての圧力発生室29のインク滴吐出特性を揃えることができる。

$\{0077\}$

さらに、このダミー圧力発生室に関し、列設方向側の幅を各圧力発生室 2 9 … の幅よりも広くしている。換言すれば、ダミー窪部 3 6 の幅を溝状窪部 3 3 の幅よりも広くしている。これにより、列端部の圧力発生室 2 9 と列途中の圧力発生室 2 9 の吐出特性をより高い精度で揃えることができる。

[0078]

さらに、本実施形態では、ケース2の先端面を部分的に窪ませて先端凹部15 を形成し、この先端凹部15と弾性板32とにより共通インク室14を区画形成しているので、共通インク室14を形成するための専用部材が不要であり、構成の簡素化が図れる。また、このケース2は樹脂成型によって作製されているので、先端凹部15の作製も比較的容易である。

[0079]

次に、上記記録ヘッド1の製造方法について説明する。なお、この製造方法では、上記の圧力発生室形成板30の製造工程に特徴を有しているので、圧力発生室形成板30の製造工程を中心に説明することにする。なお、この圧力発生室形成板30は、順送り型による鍛造加工によって作製される。また、圧力発生室形成板30の素材として使用する帯板は、上記したようにニッケル製である。

[0080]

圧力発生室形成板30の製造工程は、溝状窪部33を形成する溝状窪部形成工程と、連通口34を形成する連通口形成工程とからなり、順送り型によって行われる。

[0081]



溝状窪部形成工程では、図8に示す第1雄型51と図9に示す雌型52とを用いる。この第1雄型51は、溝状窪部33を形成するための金型である。この第1雄型には、溝状窪部33を形成するための突条部53を、溝状窪部33と同じ数だけ列設してある。また、列設方向両端部の突条部53に隣接させてダミー窪部36を形成するためのダミー突条部(図示せず)も設ける。突条部53の先端部分53aは先細りした山形とされており、例えば図8(b)に示すように、幅方向の中心から45度程度の角度で面取りされている。すなわち、突条部53の先端に形成した山形の斜面により楔状の先端部分53aが形成されている。これにより、長手方向から見てV字状に尖っている。また、先端部分53aにおける長手方向の両端は、図8(a)に示すように、45度程度の角度で面取りしてある。このため、突条部53の先端部分53aは、三角柱の両端を面取りした形状となっている。

[0082]

また、雌型52には、その上面に筋状突起54が複数形成されている。この筋状突起54は、隣り合う圧力発生室29,29同士を区画する隔壁の形成を補助するものであり、溝状窪部33,33同士の間に位置する。この筋状突起54は四角柱状であり、その幅は、隣り合う圧力発生室29,29同士の間隔(隔壁の厚み)よりも若干狭く設定されており、高さは幅と同程度である。また、筋状突起54の長さは溝状窪部33(突条部53)の長さと同程度に設定されている。

[0083]

そして、溝状窪部形成工程では、まず、図10(a)に示すように、雌型52の上面に素材であるとともに圧力発生室形成板である帯板55を載置し、帯板55の上方に第1雄型51を配置する。次に、図10(b)に示すように、第1雄型51を下降させて突条部53の先端部を帯板55内に押し込む。このとき、突条部53の先端部分53aをV字状に尖らせているので、突条部53を座屈させることなく先端部分53aを帯板55内に確実に押し込むことができる。この突条部53の押し込みは、図10(c)に示すように、帯板55の板厚方向の途中まで行う。

[0084]



突条部53の押し込みにより、帯板55の一部分が流動し、溝状窪部33が形成される。ここで、突条部53の先端部分53aがV字状に尖っているので、微細な形状の溝状窪部33であっても、高い寸法精度で作製することができる。すなわち、先端部分53aで押された部分が円滑に流れるので、形成される溝状窪部33は突条部53の形状に倣った形状に形成される。このときに、先端部分53aで押し分けられるようにして流動した素材は、突条部53のあいだに設けられた空隙部53b内に流入し隔壁部28が成形される。さらに、先端部分53aにおける長手方向の両端も面取りしてあるので、当該部分で押圧された帯板55も円滑に流れる。従って、溝状窪部33の長手方向両端部についても高い寸法精度で作製できる。

[0085]

また、突条部53の押し込みを板厚方向の途中で止めているので、貫通孔として形成する場合よりも厚い帯板55を用いることができる。これにより、圧力発生室形成板30の剛性を高めることができ、インク滴の吐出特性の向上が図れる。また、圧力発生室形成板30の取り扱いも容易になる。

[0086]

また、突条部53で押圧されたことにより、帯板55の一部は隣り合う突条部53,53の空間内に隆起する。ここで、雌型52に設けた筋状突起54は、突条部53,53同士の間に対応する位置に配置されているので、この空間内への帯板55の流れを補助する。これにより、突条部53間の空間に対して効率よく帯板55を導入することができ、隆起部を高く形成できる。

[0087]

このようにして溝状窪部33を形成したならば、連通口形成工程に移行して連通口34を形成する。この連通口形成工程では、図11に示すように、第2雄型57と第3雄型59とを用いる。ここで、第2雄型57は、第1連通口37の形状に対応する角柱状の第1連通口形成部56を複数本櫛歯状に設けたもの、即ち、複数の第1連通口形成部56…をベースから立設したものである。また、第3雄型59は、第2連通口38の形状に対応した角柱状の第2連通口形成部58を複数本櫛歯状に形成したものである。なお、第2連通口形成部58は、第1連通

口形成部56よりも一回り細い形状に作製されている。

[0088]

()

この連通口形成工程では、まず、図11(a)に示すように、第2雄型57の 第1連通口形成部56を帯板55における溝状窪部33側の表面から板厚方向の 途中まで押し込んで第1連通口37となる窪部を形成する(第1連通口形成工程)。第1連通口37となる窪部を形成したならば、図11(b)に示すように、 第3雄型59の第2連通口形成部58を溝状窪部33側から押し込んで第1連通 口37の底部を打ち抜いて第2連通口38を形成する(第2連通口形成工程)。

[0089]

このように、本実施形態では、太さの異なる連通口形成部 5 6, 5 8 を用い、 複数回の加工によって連通口 3 4 を作製しているので、極く微細な連通口 3 4 で あっても寸法精度良く作製することができる。さらに、溝状窪部 3 3 側から作製 する第 1 連通口 3 7 を板厚方向の途中までしか作製しないので、第 1 連通口 3 7 の作製時において、圧力発生室 2 9 の隔壁部 2 8 が過度に引っ張られてしまう不 具合を防止できる。これにより、隔壁部 2 8 の形状を損なうことなく寸法精度良 く作製することができる。

[0090]

なお、本実施形態では、2回の加工によって連通口34を作製する工程を例示したが、3回以上の加工によって連通口34を作製してもよい。また、上記の不具合が生じなければ、1回の加工で連通口34を作製してもよい。

 $\{0091\}$

連通口34を作製したならば、帯板55における溝状窪部33側の表面及び反対側の表面を研磨して平坦化する(研磨工程)。即ち、図11(c)に一点鎖線で示すように、溝状窪部33側の表面、及び、溝状窪部33とは反対側の表面を研磨し、これらの各表面を平坦化すると共に、板厚を所定厚さ(本実施形態では0.3mm)に調整する。

[0092]

なお、上記の溝状窪部形成工程と連通口形成工程は、別ステージで行ってもよく、同一ステージで行ってもよい。そして、同一ステージで行った場合には、両



工程において帯板55が移動しないため、溝状窪部33内に連通口34を位置精度良く作製することができる。

[0093]

以上の各工程により圧力発生室形成板30を作製したならば、別途作製された 弾性板32とノズルプレート31とを圧力発生室形成板30に接合して流路ユニット4を作製する。本実施形態では、これらの各部材の接合を接着により行っている。この接着時において、上記の研磨工程で圧力発生室形成板30の表面を平 坦化しているので、弾性板32やノズルプレート31を確実に接着できる。

[0094]

また、弾性板32はステンレス板を支持板42とする複合材であるので、その線膨張率は支持板42であるステンレスによって規定される。そして、ノズルプレート31もステンレス板によって作製されている。さらに、圧力発生室形成板30を構成するニッケルは、上記したように、線膨張率がステンレスと略等しい。以上から、接着温度を高めても線膨張率の差に起因する反りが発生しない。その結果、シリコン基板を用いていた時よりも接着温度を高めることができ、接着時間の短縮化が図れて製造効率が向上する。

[0095]

. 流路ユニット4を作製したならば、別途作製されたケース2に、振動子ユニット3と流路ユニット4とを接合する。この場合にも、これらの各部材の接合は接着によって行われている。従って、接着温度を高めても流路ユニット4には反りが発生せず、接着時間の短縮化が図れる。

(0096)

ケース2に、振動子ユニット3と流路ユニット4とを接合したならば、振動子 ユニット3のフレキシブルケーブル9と接続基板5とを半田付けし、その後、供 給針ユニット6を取り付ける。

[0097]

上述のようにして記録ヘッド1が完成するのであるが、そのなかでも特に注意 深く製作されるのが圧力発生室形成板30である。この圧力発生室形成板30に おいて圧力発生室29となる溝状窪部33は、隔壁部28を介して上記溝状窪部



33の幅方向に鍛造加工によって列設され、このような構造は非常に微細なものとして所定どおりの寸法精度や形状精度で形成されなければならない。そのためには、圧力発生室形成板30を形成する金属材料の材料的特質のなかから上記溝状窪部33にとって最良の特性値を見極めて、よりすぐれた精密鍛造を行う必要がある。

[0098]

以下、上記の課題を解決するための本発明の実施の形態について説明する。

[0099]

なお、前述の第1雄型51および雌型52により帯板(基板,素材)55に塑性加工を行うときには、常温の温度条件下であり、また、以下に説明する塑性加工においても同様に常温の温度条件で塑性加工を行っている。

[0100]

図12(A)は、図10に示した溝状窪部形成工程によって成形された圧力発生室形成板30の一部を示す断面図であり、図11(c)に示すように研磨後の状態である。また、同図(B)は、図11(a)(b)(c)に示した連通口形成工程によって成形された圧力発生室形成板30の一部を示す断面図である。なお、図12の隔壁部28の厚さは、理解しやすくするために、厚さを著しく分厚く図示してある。

[0101]

圧力発生室形成板 30 は、上述のように、ニッケル製の基板に鍛造加工を施したものであり、基板 5 5 の厚さは 0 . 3 5 mmであり、圧延工程をへて製造された圧延材が用いられている。図 8 , 図 1 0 に示すように、上記第 1 雄型 5 1 には隔壁部 2 8 を成形するための空隙部 5 3 b が各突条部 5 3 のあいだに設けられている。この空隙部 5 3 b の空間幅は隔壁部 2 8 の壁の厚さと実質的に同じであり、ここでは 3 1 μ mとされている。そして、素材 5 5 がより円滑な状態で空隙部 5 3 b 内に塑性流動を行うようにするために、上記ニッケルの結晶粒の粒径が 1 5 μ mとされている。この粒径 1 5 μ mは、隔壁部の壁の厚さ 3 1 μ mの約 5 0%に相当している。

[0102]



また、上記ニッケル製素材55の硬度は、ビッカース硬度でHv170であり、伸びは10%である。

[0103]

上記のように結晶粒の粒径が、壁の厚さの約50%とされていることにより、 結晶粒の粒径が上記空隙部53bの幅を下回っているとともに、粒径は壁の厚さ に対して過小でもなく過大でもない領域におかれているので、微細な空隙部53 b内への結晶粒の流動が円滑になされ、良好な溝状窪部33の成形が行える。

[0104]

さらに、壁の厚さ方向で見た結晶粒の配列個数は多くて2個強,少なくて2個未満となり結晶粒の個数が異常に多くなるものではないので、上記空隙部53b内への塑性流動が円滑になされる。もし、結晶粒の上記配列個数が多い側の上記個数を上回る場合には、壁の厚さに対する結晶粒の増加により、結晶粒界が隔壁部28において増量することになるので、塑性変形性(転位の運動)が低下し、空隙部53b内への塑性流動性が低下して微細な隔壁部28の塑性加工に支障を来すことになり、所定形状,所定寸法の溝状窪部がえにくくなる。

[0105]

逆に、もし、結晶粒の上記配列個数が少ない側の上記個数を下回る場合には、 塑性流動は良好に果たされるが、結晶粒の大きさが隔壁部28にとっては過大に なり、それにともなうニッケル材の強度低下のため、かえって微細な隔壁部28 を高精度に加工することが困難となる。

[0106]

本発明によれば、結晶粒の配列個数に換算すると上記のような範囲の値になるので、上記のように良好な塑性流動がえられて、所定の形状精度, 寸法精度の溝状窪部33が成形できるのである。また、結晶粒の粒径に注目した上記の数値(隔壁部28の壁の厚さの30~60%)により、塑性流動が円滑になされるので、溝状窪部33を成形する鍛造加工パンチ51の割れや素材の焼き付き等が防止されて、耐久性が大幅に向上するうえ、微細形状部の成形性を良好なものとしているのである。

[0107]

上記ニッケルは、ビッカース硬度がHv170とされているので、ニッケル自体の硬度が塑性流動に適した柔かな範囲の値とされているので、微細な溝状窪部33の成形が確実に行える。また、鍛造加工にとっては柔かな領域の硬度であるから、鍛造加工パンチ51(突条部53や先端部分53a等)の耐久性向上や加工精度の確保にとって有利である。

[0108]

さらに、上記ニッケルは、伸びが10%であるから、溝状窪部33の鍛造加工に必要な素材55の伸びが十分に確保されているので、塑性流動は十分になされる。また、鍛造加工時に生じる素材55の伸びは、上記伸びの範囲に対してわずかな量であるから、成形各部における弾性復元力を可及的に少なくすることができる。このため、残留応力の少量化にとって有効であり、鍛造加工後の弾性変形を実害のない範囲におさめることができ、溝状窪部33の成形精度の向上や圧力発生室形成板30の湾曲変形の防止に有効である。

[0109]

【表1】

△:一応よい ○:よい

◎: 非常によい

評価項目	評価対象値	評価結果
結晶粒の 粒径(μm)	10~15 μ m	0
	15∼18µm	0
	18 ~ 25μm	Δ
	25 μ m以上	×
硬度 (ピッカース 硬度)	150Hv	Δ
	150~160Hv	0
	160~180Hv	©
	180~190Hv	0
	190Hv以上	×
伸び(%)	5%以下	×
	5~10%	0
	10~20%	©
	20~30%	Δ
	30%以上	×

[0110]

ニッケル製素材55は、ニッケルの圧延材であるから、圧延による素材板55 の厚さが高精度のもとで管理される。そして、このようにして品質管理の行われ



たニッケル圧延材を鍛造加工の素材板55にするので、上記の各数値内における 良好な鍛造加工が実現し、高精度の溝状窪部33や隔壁部28が成形できる。さらに、圧延工程で形成されたニッケルの組織状態に応じて、溝状窪部33の長手 方向の向き等を選定することにより、より円滑な塑性流動がえられる。

[0111]

上記隔壁部28の厚さTを大きくすると、隔壁部28の剛性が確保されてクロストークが防止できるが、反面、圧力発生室29の列設配置密度が低下する。大きな厚さTを維持したまま圧力発生室29の列設配置数を所定どおり求めると、今度は圧力発生室29の幅が狭くなり、圧力発生室29の必要な容積が確保できなくなり、インクの吐出体積に不足をきたすことになる。このような事情から各部の寸法の最適化が必要になる。上記隔壁部28の厚さT=31μmに対する隔壁部28の高さH=45μmの比H/Tは、1.5であり、隔壁部28の剛性が低下しない程度の隔壁部28の高さHの比が確保できるので、列設された溝状窪部33の剛性を適正に確保することができる。上記の比は、1.0~2.1の範囲内であれば、良好な隔壁部28の剛性が保持できるが、好ましくは、1.2~1.8であり、上記の1.5が最善である。

[0112]

上記隔壁部 280厚さ $T=31\mu$ mに対する上記溝状窪部 330 幅W =0.1 1 mmの比W/Tは、3.5 あり、必要最小限の隔壁部 280 壁の厚さ T に対して十分な幅の溝状窪部が形成できるので、溝状窪部の容積を所定どおりに確保するとともに、溝状窪部を最も緻密な状態で列設し、単位長さ当たりの溝状窪部の列設数をできるだけ多くすることが可能となる。上記の比は、 $2.0\sim5.0$ の範囲内であれば、良好な溝状窪部の列設数がえられるが、好ましくは、 $2.9\sim4.5$ であり、上記の 3.5 が最善である。

[0113]

上記隔壁部 280厚さ T=31 μ mに対する上記溝状窪部 330深さ D=0. 1 mmの比D/Tは、3.2であり、必要最小限の隔壁部 280壁の厚さ Tに対して十分な深さ Dの溝状窪部 33 が形成できるので、溝状窪部 33 の容積を所定 どおりに確保するとともに、隔壁部 28 に十分な剛性を持たせることができる。



上記の比は、 $2.0 \sim 4.5$ の範囲内であれば、良好な溝状窪部 3.3 の容積がえられるが、好ましくは、 $2.7 \sim 4.0$ であり、上記の 3.2 が最善である。

$\{0114\}$

上記溝状窪部33の底面は溝状窪部33の長手方向に延びるV字状の形状とされ、その中央部が最深部になっている。このV字部分の内角 θ は90度であり、このような底面形状により溝状窪部33の容積を十分に拡大することができる。このように深さの方向で容積拡大ができることにより、溝状窪部33の幅を小さくすることができ、できるだけ多くの溝状窪部33を列設することができる。上記の内角 θ は、45~110度の範囲内であれば、良好な溝状窪部33の容積がえられるが、好ましくは、72~100度であり、上記の90度が最善である。

(0115)

上記溝状窪部33のピッチ寸法は0.14mmであり、精密な微細部品であるインクジェット式記録ヘッドの圧力発生室29を鍛造加工するようなときに、上記のような数値設定(例えば、結晶粒の粒径が壁の厚さの30~60%等)により、きわめて微細な溝状窪部の成形が可能となる。上記のピッチ寸法は、0.3mm以下とすることにより、液体噴射ヘッド等の部品加工等においてより好適な仕上げとなる。好ましくは、0.2mm以下であり、上記の0.14mmが最善である。

[0116]

上記圧力発生室形成板 3 0 の材料として、ニッケル板が採用されている。こうすることにより、ニッケル自体の線膨張係数が低く熱伸縮の現象が他の部品、例えばノズルプレート 3 1 や弾性板 3 2 と同調して良好に果たされ、また、防錆性にすぐれ、さらに鍛造加工で重要視される展性に富んでいる等、良好な効果がえられる。

(0117)

図12(B)は連通口34が形成された箇所の断面を示しており、上記のような結晶粒の粒径, 硬度, 伸び等とされたニッケルに対して図11に示した連通口形成工程を施すことにより、良好な穴あけ加工ができる。このように穴あけができるのは、穴あけ時に塑性流動がなされつつ打抜かれる素材が少量であるから、



その部分に含まれる結晶粒界の量が比較的少なく、ニッケル素材を容易に打抜くことが可能となる。また、打抜かれる連通口の大きさに対して結晶粒の粒径が比較的大きいものとされているので、素材の強度が打抜きにとって適当な値となり、この点においても打抜きやすい条件となる。図12(B)の場合は、隔壁部28の厚さと連通口34の内径寸法とが略同じであり、したがって、打抜かれる素材量に含まれる結晶粒界の量が少なくて、打抜き加工時に雄型の第1連通口形成部56や第2連通口形成部58の成形負荷が少なくなり、雄型の耐久性を高めるのにも有効である。

[0118]

本発明の液体噴射ヘッドの製造方法においては、請求項1~11のいずれか一項に記載の寸法,形状を備えた溝状窪部33を圧力発生室形成板30に鍛造加工により成形するものである。

[0119]

したがって、上記のような数値設定、例えば、結晶粒の粒径が壁の厚さの30~60%,ニッケルのビッカース硬度がHv150以上Hv190未満,ニッケルの伸びが5%超20%未満等の条件下で圧力発生室形成板30に鍛造加工を行うことにより、より円滑な塑性流動がえられて、形状精度,寸法精度の高い圧力発生室形成板30が形成され、引いては良好な液体噴射特性を備えた液体噴射へッド1が製造できる。また、上述のような数値設定により、鍛造加工パンチの負担が少なくてその耐久性が著しく長期化される。

(0120)

図13に例示した記録ヘッド1 ′ は、本発明を適用することのできる事例であり、圧力発生素子として発熱素子61を用いたものである。この例では、上記の弾性板32に代えて、コンプライアンス部46とインク供給口45とを設けた封止基板62を用い、この封止基板62によって圧力発生室形成板30における溝状窪部33側を封止している。また、この例では、圧力発生室29内における封止基板62の表面に発熱素子61を取り付けている。この発熱素子61は電気配線を通じて給電されて発熱する。なお、圧力発生室形成板30やノズルプレート31等、その他の構成は上記実施形態と同様であるので、その説明は省略する。

(0121)

この記録ヘッド1 ´では、発熱素子61への給電により、圧力発生室29内のインクが突沸し、この突沸によって生じた気泡が圧力発生室29内のインクを加圧する。この加圧により、ノズル開口48からインク滴が吐出される。そして、この記録ヘッド1 ´でも、圧力発生室形成板30を金属の塑性加工で作製しているので、上記した実施形態と同様の作用効果を奏する。

[0122]

また、連通口34に関し、上記実施形態では、溝状窪部33の一端部に設けた例を説明したが、これに限らない。例えば、連通口34を溝状窪部33における長手方向略中央に形成して、溝状窪部33の長手方向両端にインク供給口45及びそれと連通する共通インク室14を配置してもよい。このようにすることによりインク供給口45から連通口34に至る圧力発生室29内におけるインクの淀みを防止できるので、好ましい。

[0123]

上述の実施の形態は、インクジェット式記録装置に使用される記録ヘッドであるが、本発明における液体噴射ヘッドは、インクジェット式記録装置用のインクだけを対象にするのではなく、グルー、マニキュア、導電性液体(液体金属)等を噴射することができる。

[0124]

【発明の効果】

上記のようにニッケルの結晶粒の粒径が、壁の厚さの40~60%とされていることにより、結晶粒の粒径が上記空隙部の幅を下回っているとともに、粒径は壁の厚さに対して過小でもなく過大でもない領域におかれているので、微細な空隙部内への結晶粒の流動が円滑になされ、良好な溝状窪部の成形が行える。

[0125]

さらに、壁の厚さ方向で見た結晶粒の配列個数は多くて2個強,少なくて2個 未満となり結晶粒の個数が異常に多くなるものではないので、上記空隙部内への 塑性流動が円滑になされる。もし、結晶粒の上記配列個数が多い側の上記個数を 上回る場合には、壁の厚さに対する結晶粒の増加により、結晶粒界が隔壁部にお いて増量することになるので、塑性変形性(転位の運動)が低下し、空隙部内への塑性流動性が低下して微細な隔壁部の塑性加工に支障を来すことになり、所定 形状、所定寸法の溝状窪部がえにくくなる。

[0126]

逆に、もし、結晶粒の上記配列個数が少ない側の上記個数を下回る場合には、 塑性流動は良好に果たされるが、結晶粒の大きさが隔壁部にとっては過大になり 、それにともなうニッケル材の強度低下のため、かえって微細な隔壁部を高精度 に加工することが困難となる。

[0127]

本発明によれば、結晶粒の配列個数に換算すると上記のような範囲の値になるので、上記のように良好な塑性流動がえられて、所定の形状精度, 寸法精度の溝状窪部が成形できるのである。また、結晶粒の粒径に注目した上記の数値(隔壁部の壁の厚さの30~60%)により、塑性流動が円滑になされるので、溝状窪部を成形する鍛造加工パンチの割れや素材の焼き付き等が防止されて、耐久性が大幅に向上するうえ、微細形状部の成形性を良好なものとしているのである。

【図面の簡単な説明】

【図1】

インクジェット式記録ヘッドの分解斜視図である。

【図2】

インクジェット式記録ヘッドの断面図である。

【図3】

(A)及び(B)は、振動子ユニットを説明する図である。

【図4】

圧力発生室形成板の平面図である。

【図5】

圧力発生室形成板の説明図であり、(a)は図4におけるX部分の拡大図、(b)は(a)におけるA-A断面図、(c)は(a)におけるB-B断面図である。

【図6】

弾性板の平面図である。

【図7】

弾性板の説明図であり、(a)は図6におけるY部分の拡大図、(b)は(a)におけるC-C断面図である。

【図8】

(a)及び(b)は、溝状窪部の形成に用いる雄型を説明する図である。

【図9】

(a) 及び(b) は、溝状窪部の形成に用いる雌型を説明する図である。

【図10】

(a)~(c)は、溝状窪部の形成を説明する模式図である。

【図11】

(a)~(c)は、連通口の形成を説明する模式図である。

【図12】

溝状窪部の部分を示す断面図である。

【図13】

変形例のインクジェット式記録ヘッドを説明する断面図である。

【符号の説明】

- 1 インクジェット式記録ヘッド
- 1 インクジェット式記録ヘッド
- 2 ケース
- 3 振動子ユニット
- 4 流路ユニット
- 5 接続基板
- 6 供給針ユニット
- 7 圧電振動子群
- 8 固定板
- 9 フレキシブルケーブル
- 10 圧電振動子
- 10a ダミー振動子

4 2

支持板

特願2002-243483

4 3 "	弾性体膜	
4 4.	ダイヤフラム部	
4 5	インク供給口	
4 6	コンプライアンス部	
4 7	島部	
4 8	ノズル開口	
5 1	第1 雄型	
5 2	雌型	
5 3	突条部	
5 3 a	先端部分	
5 3 b	空隙部	
5 4	筋状突起	
5 5	带板,素材,金属素材板,	(圧力発生室形成板)
5 6	第1連通口形成部	
5 7	第2雄型	
5 8	第2連通口形成部	
5 9	第3雄型	
6 1	発熱素子	
6 2	封止基板	

T

Η

W

D

 θ

隔壁部の厚さ寸法

隔壁部の高さ寸法

溝状窪部の幅寸法

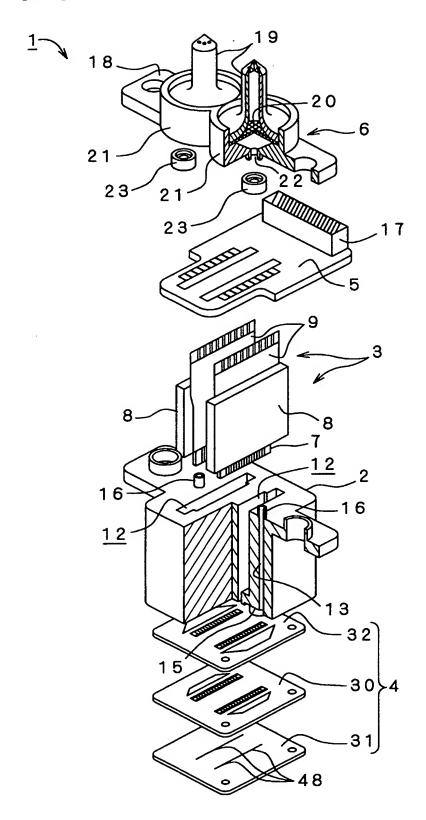
V型底部の内角

溝状窪部の深さ寸法

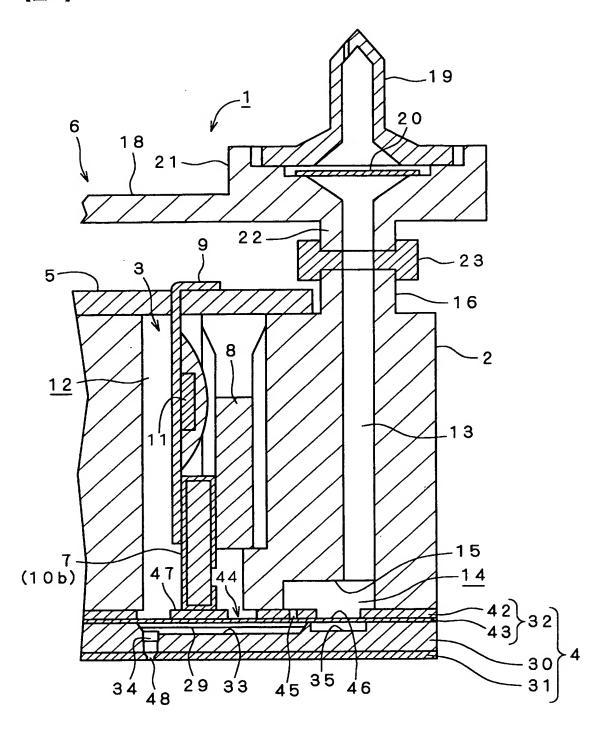
ページ: 36/E

【書類名】 図面

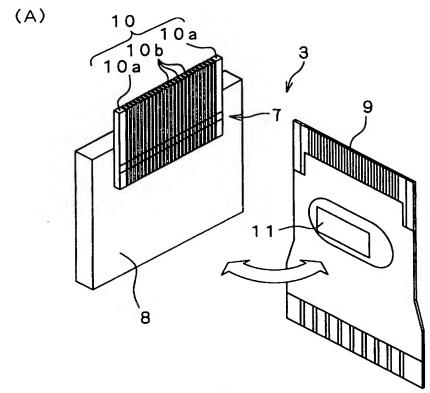
【図1】

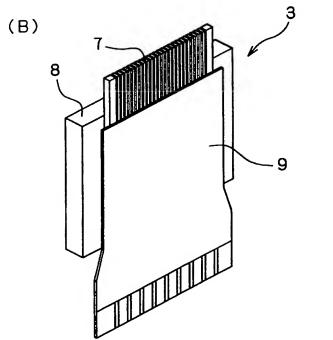


【図2】

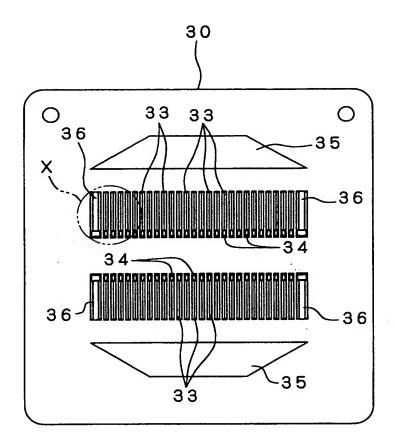


【図3】

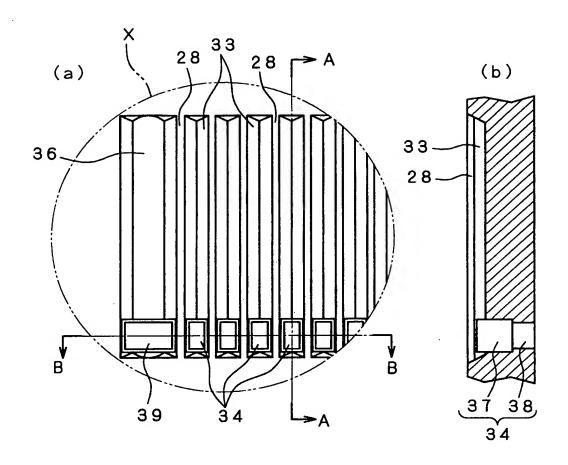


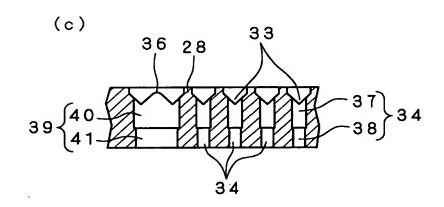


[図4]

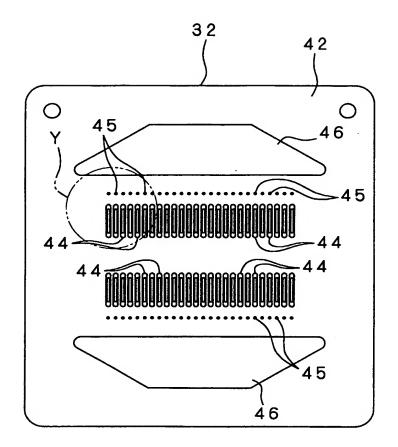


【図5】

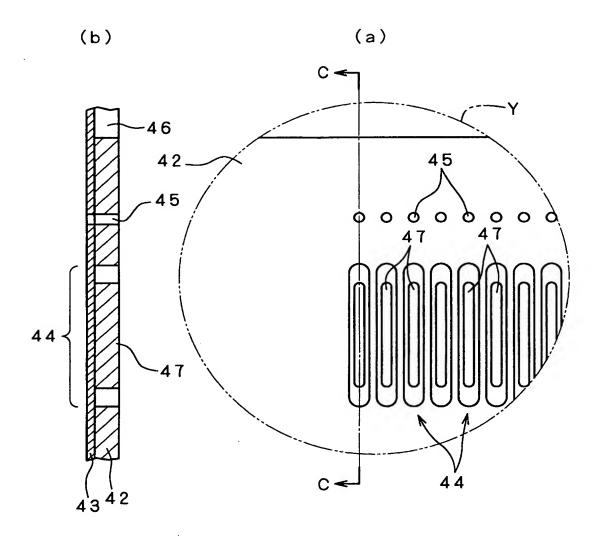




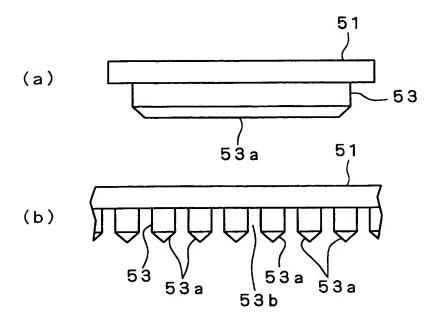
【図6】



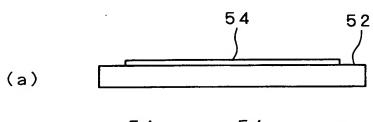
【図7】

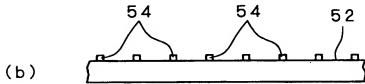


[図8]

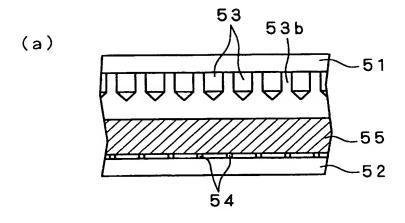


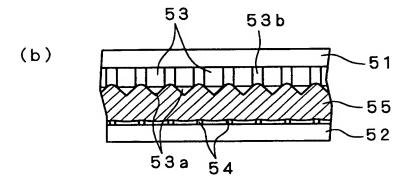
【図9】

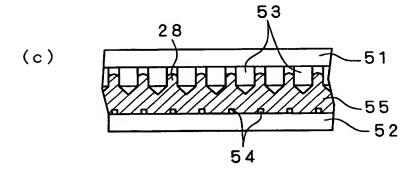




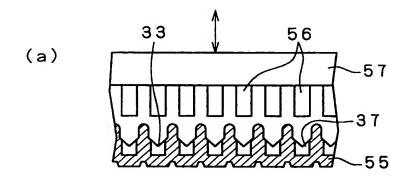
【図10】

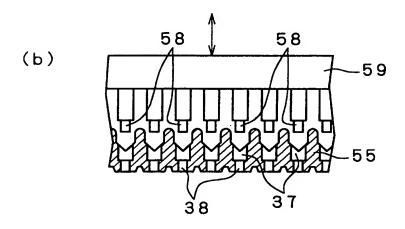


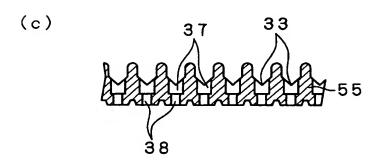




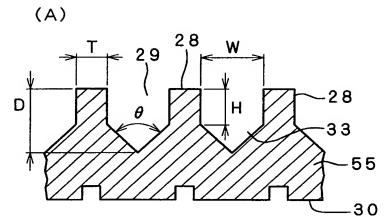
【図11】



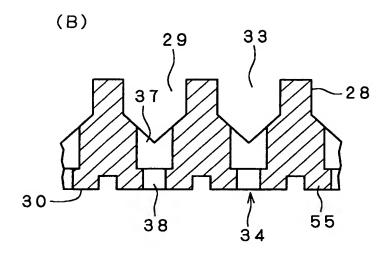




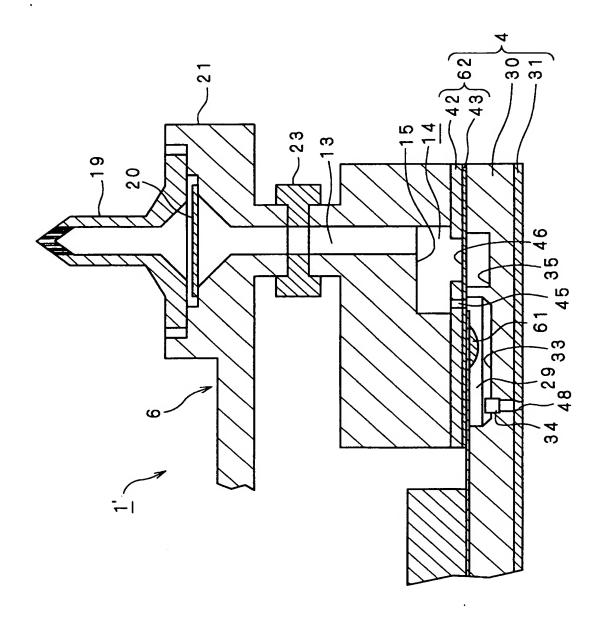
【図12】



 $T=31 \mu m$, $H=45 \mu m$, W=0.11 mm, D=0.1 mm $\theta=90$ 度



【図13】"



【書類名】要約書

【要約】

【課題】圧力発生室形成板用金属材料の材料的特質のなかから溝状窪部にとって 最良の特性値を見極めて、よりすぐれた鍛造加工を行う液体噴射ヘッドおよびそ の製造方法を提供する。

【解決手段】溝状窪部33が隔壁部28を介して溝状窪部33の幅方向に列設されたニッケル製の圧力発生室形成板30と、ノズル開口48を穿設した金属製のノズルプレート31と、溝状窪部33の開口面を封止する金属製の封止板とを備えた流路ユニット4を有する液体噴射ヘッド1であって、ニッケルの結晶粒の粒径が隔壁部28の厚さの30~60%とされている。結晶粒の粒径が雄型52の空隙部53bの幅を下回っているとともに、粒径は壁の厚さTに対して過小でもなく過大でもない領域におかれているので、微細な空隙部53b内への結晶粒の流動が円滑になされ、良好な溝状窪部33の成形が行える。

【選択図】図12

ページ: 1/E

認定・付加情報

特許出願の番号

特願2002-243483

受付番号

5 0 2 0 1 2 5 1 2 7 1

書類名

特許願

担当官

第二担当上席

0 0 9 1

作成日

平成14年 9月 2日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成14年 8月23日

特願2002-243483

出願人履歴情報

識別番号

[000002369]

1990年 8月20日

1. 変更年月日 [変更理由]

由] 新規登録

住所氏名

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

セイコーエプソン株式会社